

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成23年4月14日(2011.4.14)

【公開番号】特開2010-109257(P2010-109257A)

【公開日】平成22年5月13日(2010.5.13)

【年通号数】公開・登録公報2010-019

【出願番号】特願2008-281498(P2008-281498)

【国際特許分類】

H 01 L 21/66 (2006.01)

G 01 N 21/93 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/66 Z

H 01 L 21/66 J

G 01 N 21/93

【手続補正書】

【提出日】平成23年3月1日(2011.3.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板を検査する検査装置において、

前記基板へ光を照射する照射光学系と、

前記基板からの光を検出する検出光学系と、

処理部とを有し、

前記処理部は、

原子間力顕微鏡による前記基板の粗さの測定結果をフーリエ変換し、

前記フーリエ変換の結果を平均化し、

前記平均化の結果を空間周波数関数へ変換し、

前記空間周波数関数を用いて前記測定結果を前記検出光学系の検出信号に相当する第1の信号に変換し、

前記第1の信号と、前記検出光学系で検出された第2の信号とを比較することで前記検査装置を校正することを特徴とする検査装置。

【請求項2】

基板を検査する検査装置を用いた検査方法において、

原子間力顕微鏡による前記基板の粗さの測定結果をフーリエ変換し、

前記フーリエ変換の結果を平均化し、

前記平均化の結果を空間周波数関数へ変換し、

前記空間周波数関数を用いて前記測定結果を光電変換信号に相当する第1の信号に変換し、

前記第1の信号と、前記基板からの光を光電変換した第2の信号とを比較することで前記検査装置を校正し、

前記基板を検査することを特徴とする検査方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】検査装置および検査方法